

Verspiegelung für optische Teile

Produkt

BERLINER GLAS fertigt hochwertige Vorder- und Rückflächenspiegel, die im Strahlengang optischer Geräte eingesetzt werden und bietet Schichtdesign an.

Substrate

Als Substrat wird optisches Glas, Flachglas, Quarz, Glaskeramik und Borosilikatglas verwendet.

Spezifikationen

Aluminiumspiegel mit Schutzschichten

- Reflexionen:
 - R max. \geq 90 %
 - R max. \geq 94 %
 - R max. \geq 97 % gemessen bei 550 nm
- Haftfestigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit: Nach MIL-M-13508 C
- Abriebfestigkeit: Nach MIL-M-13508 C

UV-Anwendungen

- Aluminium mit MgF₂-Schutzschicht für UV-Anwendungen bis 187 nm
- Aluminium mit SiO₂-Schutzschicht für UV-Anwendungen bis 200 nm

IR-Spiegel

- Goldspiegel für Infrarotanwendungen ab 600 nm

Hochreflektierende Spiegel

- Silberspiegel, Dielektrische Spiegel, Hochreflektierend für eine oder mehrere Wellenlängen, Laserspiegel mit hoher Zerstörschwelle

Andere Beschichtungen auf Anfrage:

z. B. Chromschichten (auch reflexgemindert), Teilerspiegel, Kantenfilter und Kaltlichtspiegel. Schichtrechenprogramme stehen zur Verfügung.

Qualitätssicherung

Wir führen eine permanente Prozess- und Fertigungsüberwachung durch.

Hinweise

Lohnbeschichtungen auf Kundensubstraten werden durchgeführt. Für die verschiedenen Möglichkeiten der Formgebung des Substrates beachten Sie bitte die Produktinformation „CNC Formgebung“. Die aufgeführten Beschichtungen zeigen nur einen Ausschnitt unserer Beschichtungsmöglichkeiten. Wir entwickeln darüber hinaus individuelle Lösungen.

Messinstrumente zur Qualitätssicherung

Wellenfront:	Interferometer, 4-24", Shack-Hartmann-Wellenfront-Sensor (UV und DUV)
Abbildungsleistung:	Computergestützte MTF-Messanlage, Mikroskopischer Auflösungstest
Winkel:	Goniometer, Interferometer
Transmission/ Reflexion:	Spektralphotometer, Diodenarray
Oberflächengüte:	Automatische Messmikroskope
Formabweichung:	3D-Koordinaten-Messgerät, Messtaster, CCD-Mikrometer, 0-30 mm, Stitching Interferometer
Mikrorauigkeit:	Weisslicht-Interferometer, AFM
Zentrierung:	Objektivprüfvorrichtung, Laserzentriervorrichtung